



(別紙1)

## 福岡超集積半導体ソリューションセンター 機器利用料金単価表

(令和8年4月1日改訂)

No.	機器名	設置場所	料金(税抜)
7	乾燥炉200°C	クリーンルームB	3,900
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB	4,160
11	クリーンローラ	クリーンルームB	3,120
12	真空ラミネータ	クリーンルームB	10,140
21	プリント基板用直接描画装置	クリーンルームB	38,740
23a	乾燥炉360°C	クリーンルームB	3,900
23b	乾燥炉	クリーンルームE	3,900
23c	乾燥炉Si専用	クリーンルームD	3,900
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB	8,970
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC	5,330
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD	7,410
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD	10,920
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD	3,900
46	オートマチックサーフェスグラインダー	クリーンルームD	14,950
48	オートマチックダイシングソー	クリーンルームD	10,140
49	ストレスリリーフ研磨装置	クリーンルームD	13,390
R1	高温クリーンオープン	クリーンルームD	11,050
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE	4,680
53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルームE	18,590
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉 (8インチ/12インチウェハー)	クリーンルームE	10,790
50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルームF	20,410
51	絶縁膜形成装置	クリーンルームF	19,110
52	縦型酸化炉	クリーンルームF	10,660
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡	クリーンルームF	17,290
40	微細パターン加工装置	クリーンルームG	22,490
41	スピンドーター	クリーンルームG	6,370
42	アルカリデベロッパー	クリーンルームG	7,020
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	6,890
17	プロダクションモジュラー	実装エリア	7,800
19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	15,860
24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	7,540
32	内蔵部品検査装置	実装エリア	11,310
R5	熱衝撃試験機	実装エリア	1,690
13	乾燥炉200°C	水平ライン室	3,900

No.	機器名	設置場所	料金（税抜）
27	基板用現像装置	水平ライン室	14,560
28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	12,610
29	レジスト剥離装置	水平ライン室	18,850
31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	16,770
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室	9,750
34	積層前粗化処理装置	めっきライン室	15,210
35	デスマリア装置	めっきライン室	18,460
36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	15,860
37	電解ビアフィルめっき装置	めっきライン室	20,150
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	7,670
4	プリント基板穴明機	機械加工室	8,450
5	プリント基板外形加工機	機械加工室	7,020
8	ピン立て装置	機械加工室	4,160
20	プリント配線板用UV+CO <sub>2</sub> レーザ加工機	機械加工室	20,540
60a	恒温恒湿振動試験機（複合試験）	信頼性試験室	8,100
60b	恒温恒湿振動試験機（振動試験）	信頼性試験室	6,100
60c	恒温恒湿振動試験機（温度試験）	信頼性試験室	2,000
61	衝撃試験装置	信頼性試験室	10,790
62	自動切断機	信頼性試験室	1,170
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	5,330
57	プロービングシステム	電気特性評価室	4,420
R3	プロービングシステム（120GHz）	電気特性評価室	5,460
58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	15,470
59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	7,150
74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	3,770
R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	43,719
R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室	7,150
2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	13,910
L1	レーザー顕微鏡	検査室	6,110
L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	15,080
L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	7,410
L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	5,200
L5	FIB	クリーンルームC	17,420
L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルームG	6,890
L8	酸化膜エッチング装置	クリーンルームF	11,830
80	反応性イオンエッチング装置	クリーンルームF	13,650
81	超音波探傷装置	実装エリア	11,440
82	有機溶剤現像装置	クリーンルームG	11,700

No.	機器名	設置場所	料金（税抜）
L9	ピール試験機	検査室	4,290
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	3,250
s1	ウェハ銅ポストめっき	クリーンルーム E	5,590
s2	SnAgめっき	クリーンルーム E	5,590
s3	電解Niめっき	クリーンルーム E	32,500
s4	Ni/Auめっき	クリーンルーム E	66,040
81	ドライフィルム剥離	クリーンルーム F	3,900
s5	チタン/Cu スパッタ	クリーンルーム F	52,780
s6	二流体洗浄装置	クリーンルーム E	7,540
s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	132,600
83	基板用Niめっき	水平ライン室	10,400
84	基板用Niめっき 温調利用のみ	水平ライン室	3,900
E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルーム C	2,210
85	電波強度測定器	電波暗室	7,400
86	シグナルアナライザ	無線通信評価開発室	4,400
87	ネットワークアナライザ	無線通信評価開発室	6,200
88	オシロスコープ	無線通信評価開発室	5,700
89	卓上EMCノイズスキャナ	無線通信評価開発室	900
90	切削RPマシン	NC工作室	1,000
91	超広帯域信号源解析システム	製品・試作品改良室	3,000
92	恒温恒湿槽	製品・試作品改良室	700

※ 福岡県内の中小企業又は福岡県外の中小企業であって福岡県内に事業所を有し、かつ利用者の勤務地が当該事務所であるものについては、5分の1を減免する。  
減免を受ける場合は、必ず機器の利用実績報告までに当センターへ申し出るようお願いいたします。

## 福岡超集積半導体ソリューションセンター 工賃・技術料について

## ●技術工賃単価

- ・ 下記の操作サポート及び受託<sup>※</sup>を除き、46,800円/時

※受託は原則として実施しないが、実施する場合は101,400円/時

- ・ 従来の技術料は廃止

## ●操作サポート工賃単価

以下の機器については、操作方法の補助のみの場合、26,000円/時とする。

No.	機器名	設置場所
7	乾燥炉200°C	クリーンルーム B
9	予熱ラミネーター	クリーンルーム B
11	クリーンローラ	クリーンルーム B
23a	乾燥炉360°C	クリーンルーム B
23b	乾燥炉	クリーンルーム E
23c	乾燥炉Si専用	クリーンルーム D
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルーム B
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルーム C
L4	ボンドテスタ	クリーンルーム C
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルーム D
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルーム D
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルーム D
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルーム E
L7	ウェハープラズマクリーナー	クリーンルーム G
L1	レーザー顕微鏡	検査室
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室
8	ピン立て装置	機械加工室
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア
32	内蔵部品検査装置	実装エリア
60a	恒温恒湿振動試験機(複合試験)	信頼性試験室
60b	恒温恒湿振動試験機(振動試験)	信頼性試験室
60c	恒温恒湿振動試験機(温度試験)	信頼性試験室
61	衝撃試験装置	信頼性試験室
62	自動切断機	信頼性試験室
63	自動研磨機(64研磨濾過器含む)	信頼性試験室
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室